Vol 19,No. 7 July, 1998

多模干涉导波 Sii- xGex/Si 波分复用器*

李宝军 李国正 刘恩科

(西安交通大学微电子工程系 西安 710049)

摘要 利用多模干涉自成象原理分析设计了具有较小循环周期比的 $1.3\mu m$ 与 $1.55\mu m$ 波长的 $Sio_{96}Geo_{04}/Si$ 波分复用器 通过模的传播分析法对其传输特性进行分析发现, 在 $8\mu m$ 的耦合 区宽度和 $1150\mu m$ 的最佳耦合长度, 这种器件对 $1.3\mu m$ 和 $1.55\mu m$ 波长光的对比度均在 $40\mu m$ 以上, 且插入损耗小于 $4.0\times10^{-3}\mu m$ dB.

EEACC: 6150C, 5230, 1320

1 引言

波分复用器(W avelength D ivision M ultip lexing W DM) 是光通信系统中的重要器件,它能增大单模光纤通信系统的信息容量 虽然已研制出了包括定向耦合器[1]、不对称 Y 分支器[2]、不对称M ach-Zehnder 干涉仪[3]等在内的具有波分复用功能的器件,但这些W DM 的运作波长不完全在光纤通信的主要波段(1.3μ m 和 1.55μ m). 因而,人们又研制[4-6]和设计[7.8]出了 1.3μ m 和 1.55μ m 波长的W DM. 可惜的是所研制的器件[4-6]难以与 Si 微电子器件很好地进行单片集成 近年来,随着多模干涉在集成光学中的迅速应用[9-11],人们已研制出了多模干涉(M ultitM ode Interference MM I) W DM [12-14]. 尽管这些MM IW DM 的适用波长和所用的材料各不相同,但MM IW DM 一个诱人的优点就是低的损耗、小的尺寸和大的制作容限 这给研制易于单片集成的低损耗W DM 指明了方向 另外,在 Si 基 SiGe 光波导[15,16]和 SiGe/Si 无间距定向耦合器[17,18]方面的研制成功,使得用MM I 自成象原理设计和研制既能满足 1.3μ m 和 1.55μ m 光通信波长、又能利用成熟的 Si 工艺实现大规模单片集成的 Si 基 MM IW DM 成为可能 为此,本文率先用MM I 原理分析和设计了 1.3μ m 和 1.55μ m 波长的 Si 基 SiGe W DM,为下一步的实验工作奠定了基础

2 WDM 的基本结构

图 1(a) 是 Sii- xGex 脊形波导WDM 的结构示意图, 它是在 Si(100) 衬底上生长 Sii- x

^{*} 国家自然科学基金(69636040)重点资助项目

李宝军 男, 1964年出生, 博士生, 讲师, 目前从事 Si 基光电子器件及其集成技术的研究

李国正 男, 1939 年出生, 副教授, 主要从事微电子技术和 Si 基光电子器件及其集成技术的研究

刘恩科 男, 1930 年出生, 教授, 博导, 主要从事微电子技术和 Si 基光电子器件及集成光学和技术的研究 1997-04-05 收到, 1997-09-06 定稿

Ge_x 层形成的 图中 $_W$ (= $2a\lambda$) 是脊宽, h (= $2b\lambda$) 是内脊高, h (= $2b(1-r)\lambda$) 是腐蚀深度 a 和 b 分别是脊宽和脊高因子, r 是腐蚀深度因子, λ 是自由空间的光波长 图 1 (b) 是其顶视图, W_M 和 L_M 分别是MM I 区的宽度和耦合长度 当 1.3μ m 和 1.55μ m 波长的光由W DM 的一端耦合入基模后, 该基模传输到MM I 区时, 因波导宽度突然增大, 其场宽也必然增大由于增大了的场宽与基模之间不满足连续性条件, 必然同时伴随着另外模式—多模的激发这样, 这些模在MM I 区发生干涉. 由于各种模的传播常数不同, 因而存在着相位差. 如果MM I 区的长度 L_M 满足一定条件, 则可将 1.3μ m 和 1.55μ m 波长光干涉所成的象通过输出端的两单模波导分离开并输出

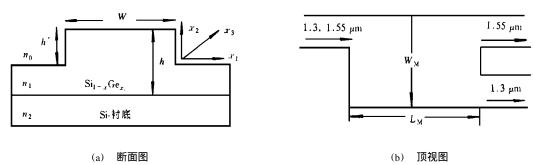


图 1 Si_{1-x}Ge_x脊形波导WDM 的结构示意图

3 理论

3.1 Site *Ge* 眷形波导

WDM 的输入和输出端是由单模波导构成的,中间部分为多模干涉区 为了使WDM 的输入端和两输出分支端只传输单模光,其横向和纵向结构尺寸必须满足单模条件. 根据文献 [19], 当脊高 $h>4\lambda$ 时,单模脊形光波导的脊宽与内脊高之比应满足:

$$\frac{a}{b} \quad \left(\frac{q + 4\pi b}{4\pi b}\right) \times \frac{1 + 0 \cdot 3\sqrt{\frac{Q + 4\pi b}{q + 4\pi rb}^2 - 1}}{\sqrt{\frac{q + 4\pi b}{q + 4\pi rb}^2 - 1}}$$
(1)

$$q = \frac{Y_0}{\sqrt{n_1^2 - n_0^2}} + \frac{Y_2}{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}$$
 (2)

对HE 模, $\mathcal{Y}_{0,2} = 1$; 对EH 模, $\mathcal{Y}_{0,2} = (n_{0,2}/n_1)^2$.

3 2 MM I 区的场分布

在MM I区, 光场分布 $\Psi(x_1, x_2, x_3)$ 可写为二维标量 Helm holtz 波动方程

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x_{1}^{2}} + \frac{\partial \Psi}{\partial x_{2}^{2}} + \left(\frac{2\pi \ln(x_{1}, x_{2})}{\lambda}\right)^{2} \Psi = \beta^{2} \Psi$$
(3)

$$\Psi(x_1, x_2, x_3) = \int_{y=0}^{m-1} C_y \Psi_v(x_1, x_2) \exp\left[i(\omega t - \beta_v x_3)\right]$$
 (4)

其中 x_1 表示横向; x_2 表示纵向; x_3 是传播方向; C_v 是场的激发系数; $\Psi_v(x_1, x_2)$ 是模场; $n(x_1, x_2)$ 是折射率; β_v 是模的传播常数; $\nu=0, 1, 2, \dots (m-1)$ 是波导支持的模数 其横向波数 k_{x_1} 和传播常数 β_v 与脊形波导的折射率 n_r 满足下面的色散关系

$$k_{x_1 v}^2 + \beta_v^2 = k_0^2 n_r^2 \tag{5}$$

$$k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0} \tag{6}$$

$$k_{x_1 \nu} = \frac{(\nu + 1)\pi}{W_{\text{ev}}} \tag{7}$$

其中 W。是考虑了边界处由 Goos-Hahnchen 位移引起每个模场横向穿透深度后的有效宽度 一般情况下,有效宽度W。可用基模的有效宽度W。近似,为了简单起见用W。表示,即:

$$W_{\text{ev}} \quad W_{\text{e}} = W_{\text{M}} + (\lambda_0/\pi) (1/n_{\text{r}})^{2\sigma} (n_{\text{r}}^2 - 1)^{-1/2}$$
 (8)

对 TE 偏振模 σ = 0, 对 TM 偏振模 σ = 1. 由于 $k_{x_1}^2 \ll k_0^2 n_r^2$, 由 (5) ~ (7) 式并用二项式展开可得传播常数

$$\beta_{\nu} = k_0 n_r - \frac{(\nu + 1) \pi \lambda_0}{4 n_t W_e^2} \tag{9}$$

由此可知,传播常数 β ,与模数 ν 近似成二次关系,且不同波长的传播常数也不同 为了后面设计方便,这里定义两个最低级模 ν = 0,1 的循环长度 L_π 为

$$L_{\pi} \cong \frac{\pi}{\beta_0 - \beta_1} \qquad \frac{4nW_{c}^{2}}{3\lambda_0} \tag{10}$$

则可得

$$(\beta_0 - \beta_v) \qquad \frac{\nu(\nu + 2)\pi}{2L\pi} \tag{11}$$

为了更加明显清楚, 略去 (4) 式中的时间因子 $\exp(j\omega t)$, 并以基模的相作为求和的共同因子, 则场分布 $\Psi(x_1, x_2, x_3)$ 变为

$$\Psi(x_1, x_2, x_3) = \int_{0.5}^{m-1} C_{\nu} \Psi_{\nu}(x_1, x_2) \exp\left[i(\beta_0 - \beta_{\nu})x_3\right]$$
 (12)

将(11)式代入可得 $x_{3}+L$ 处的场分布为

$$\Psi(x_1, x_2, x_3 + L) = \int_{y=0}^{m-1} C_y \Psi_y(x_1, x_2) \exp\left[i \frac{y(y+2)\pi}{3L\pi}(x_3 + L)\right]$$
 (13)

由此可知, $\Psi(x_1, x_2, x_3 + L)$ 是 $\Psi(x_1, x_2, x_3)$ 在 $x_3 + L$ 处的象, 取决于模的激发系数 C_v 和模的相因子特性

$$\exp\left[i\frac{\nu(\nu+2)\pi}{3L\pi}(x_3+L)\right] \tag{14}$$

从而得到在 x_3+L 处形成 x_3 处象的条件是

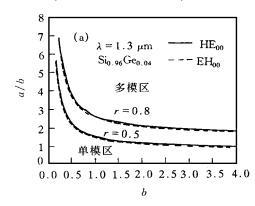
$$L = p(3L_{\pi})$$
 $p = 0, 1, 2, ...$ (15)

4 设计

4.1 Site x Gex 脊形波导的设计

 $Sii_{-x}Ge_xWDM$ 是在 Si 衬底上生长 $Sii_{-x}Ge_x$ 应变合金层形成的 $Sii_{-x}Ge_x/Si$ 结构 由于 $Sii_{-x}Ge_x$ 合金层的晶格常数与 Ge 含量 X 有关, 且于 Si 的晶格常数不同, 因而 $Sii_{-x}Ge_x/Si$ 是一种典型的晶格失配结构体系, Ge 含量 X 越大, 晶格失配率越大 为了减小 $Sii_{-x}Ge_x/Si$

界面间的失配位错,就必须选用较小的 Ge 含量,并使 $Sil_{-x}Ge_x$ 合金层的厚度控制在产生失配位错的最大临界厚度之内 由于用作光波导的 $Sil_{-x}Ge_x$ 合金的 x=15%,因而这里选取 x=0.04,则应变 $Sil_{-x}Ge_x$ 合金层的临界厚度为 $6.5\mu m^{[20]}$ 由单模波导的内脊高 $h>4\lambda$ 可得,传播 $1.3\mu m$ 和 $1.55\mu m$ 波长光的 $h(=2b\lambda)$ 应大于 $6.2\mu m$,又要小于临界厚度 $6.5\mu m$,从而选取 $h=6.35\mu m$. 图 2(a)、(b) 分别是 $\lambda=1.3\mu m$ 和 $1.55\mu m$ 时 a/b 与 b 的关系 图中给出了 r=0.5, 0.8 两种值的情况 为了方便,下面以 r=0.5 为例,则对应的腐蚀深度为 $h=3.175\mu m$. 由对应于 $\lambda=1.3\mu m$ 和 $1.55\mu m$ 的 a/b 应分别小于 $1.14\mu m$ 和 $1.2\mu m$ 可确定出脊宽 $w=2.5\mu m$ ($<2a\lambda_{1.3}=2.964\mu m$).



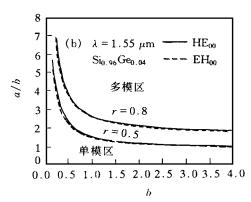


图 2 SiGe 脊形波导的 a/b 与 b 关系
(a) λ= 1.3μm, (b) λ= 1.55μm.

4.2 MM I 区的设计

W DM 的核心部分是MM I 区, 在波导的内脊高和腐蚀深度一定的情况下, 耦合区宽度 (W_M) 应大于 2w (= 5μ m), 从而由(8) 式知W。应大于 5.148μ m. 考虑到W。太大时MM I 区的长度 L_M 也很大, 不宜于单片集成, 因而选取W。= 8.148μ m, 则耦合区宽度 W_M = 8μ m. 另外, 从图(2) 可知, 当 W_M = 8μ m, a/b 已在多模区, 这正好满足了W DM 的多模干涉条件 在MM I 区, 不同模的传播常数随波长的不同而不同, 因而各模具有不同的相速度, 从而可将 1.3μ m 和 1.55μ m 波长的光干涉所成的象分别经直通波导和交叉波导而分开输出 其对比度 (Contrast-C) 和插入损耗 (Insertion Loss- L_A) 分别为[13]

$$C = 10\log_{10}(P_1/P_2) \tag{16}$$

$$L_{\rm I} = -10\log_{10}(P_{\rm I}/P_{\rm i}) \tag{17}$$

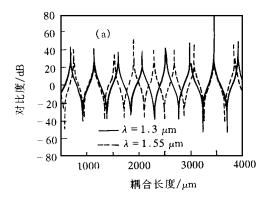
其中 P_1 和 P_2 分别是波长为 1.3μ m 的光在波导的直通和交叉输出端的强度、或波长为 1.55μ m 的光在波导直通和交叉端的输出的强度; P_1 是输入的强度

由于不同波长的模数具有相差比较大的传播速度, 因而其最小循环周期 $L_{\pi\lambda}$ 和 $L_{\pi\lambda}$ 也不同, 它们和MM I 区的耦合长度之间有关系式

$$L_{\rm M} = pL_{\pi,\lambda_1} = (p+q)L_{\pi,\lambda_2} \tag{18}$$

其中 p 是正整数; q 是奇数 为了得到尽可能短的耦合长度, 文献 [14]选择了 p=2, q=1, $L_{\pi\lambda_1}/L_{\pi\lambda_2}$ 为 1.5 本文经研究发现, 通过选择比, 还可以使器件的长度进一步缩小 这一结果可从图 3 看出

由(10)式计算得到, 在 $W_{\rm M}=8\mu{\rm m}$ 时, 对应于 $\lambda=1.3\mu{\rm m}$ 和 $\lambda=1.55\mu{\rm m}$ 波长光的最小



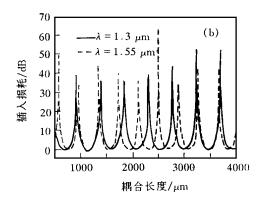


图 3 $W_{M} = 8\mu m$ 时WDM 的对比度(a)和插入损耗(b)

循环周期分别为 $L_{\pi\lambda_1} = 230.33 \mu m$ 和 $L_{\pi\lambda_2} = 191.53 \mu m$,其比值为 1.2,因而得到 p = 5, q = 1. 从而由 (18) 式得到最佳耦合长度 $L_{\rm M} = 1150 \mu m$. 图 4 是输出与输入端的光强之比随耦合区长度的变化关系 图 5(a)、(b) 分别是最佳耦合长度 $L_{\rm M} = 1150 \mu m$ 时的对比度和插入损耗 由图 4 和图 5 可看出,在 $L_{\rm M} = 1150 \mu m$ 时,这种结构的器件不但具有最大的输出与输入光强之比,而且对 $1.3 \mu m$ 和 $1.55 \mu m$ 波长的光具有 40 d B 以上的对比度和小于 $4.0 \times 10^{-3} d B$ 的插入损耗

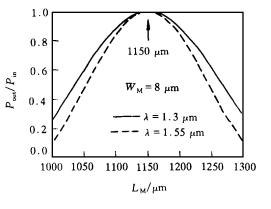
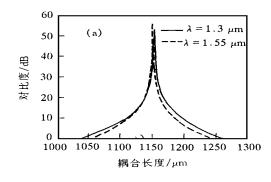


图 4 输出与输入端的光强之比 随耦合区长度的变化关系



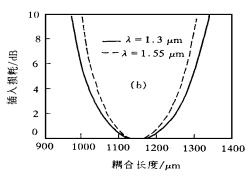


图 5 最佳耦合长度Lm= 1150µm 时WDM 的对比度(a)和插入损耗(b)

5 结论

利用多模干涉原理, 经详细的理论分析, 设计出了适用于光通信波长 $1.3\mu m$ 与 $1.55\mu m$ 的一种新型导波 Si 基 SiGe 波分复用器 其输入和输出端单模波导的内脊高为 $6.35\mu m$, 腐蚀深度为 $3.175\mu m$, 脊宽为 $2.5\mu m$. 在多模干涉耦合区宽度 W_M 为 $8\mu m$ 时最佳耦合长度 L_M

等于 1150μ m. 这种波分复用器的尺寸小,制作工艺简单,易于实现 Si 基光电子器件的单片集成和满足光纤通信系统大容量的需要 利用模的传播分析法对其传输特性进行研究得到,这种结构的波分复用器对 1.3μ m 和 1.55μ m 波长的光具有 $40\,d$ B 以上的对比度和小于 $4.0\,$ × $10^{-3}\,d$ B 的插入损耗

参 考 文 献

- [1] T. Kitagawa, K. Hattori, Y. Hibino et al., Proc. ECOC, 1992, 907.
- [2] T. Negami, H. Haga and S. Yamamoto, Appl Phys Lett, 1989, 54(12): 1080
- [3] A. Tervonen, P. Poyhonen, S. Honkanen et al., IEEE Photon Technol Lett., 1991, 3(6): 516
- [4] N. Goto and G. L. Yip, Electron Lett., 1990, 26(2): 102
- [5] F. Xiang and G. L. Yip, IPR Tech. Dig., 1994, 3: 130.
- [6] F. Xiang and G. L. Yip, J. Lightwave Technol, 1996, 14(7): 1690
- [7] 李宝军, 李国正, 刘恩科, 半导体学报, 1997, 18(4): 281.
- [8] 李宝军, 李国正, 刘恩科, 半导体光电, 1997, 18(5): 297.
- [9] G. M. Berry and S. V. Burke, Opt. Quantum Electron., 1995, 27: 921.
- [10] L. B. Soldano and E. C. M. Pennings, J. Lightwave Technol, 1995, 13(4): 615.
- [11] K.C. Lin and W.Y. Lee, Electron Lett , 1996, 32(14): 1259.
- [12] P. A. Besse, M. Bachmann, H. Melchior et al., J. Lightwave Technol., 1994, 12(6): 1004
- [13] C. F. Janz, M. R. Paiam, B. P. Keyworth et al., IEEE Photon Technol Lett., 1995, 7(9): 1037.
- [14] M. R. Paiam, C. F. Janz, R. I MacDonald et al., IEEE Photon Technol Lett., 1995, 7(10): 1180
- [15] S. F. Pesarcik, G. V. Treyz, S. S. Iyer et al., Electron Lett., 1992, 28(2): 159.
- [16] Y. M. Liu and P. R. Prucnal, Electron Lett, 1992, 28(15): 1434
- [17] R. A. Mayer, K. H. Jung, T. Y. Hsieh et al., Appl Phys Lett., 1991, 58(24): 2744
- [18] Y. Gao, G. Z. Li, X. D. Liu et al., Electron Lett., 1995, 31(20): 1740.
- [19] R. A. Soref, J. Schmidtchen and K. Petermann, IEEE J. Quantum Electron, 1991, 27(8): 1971.
- [20] 李宝军, 刘恩科, 李国正, 光学学报, 1997, 17(12): 1718

Guide-Wave Si_{1-x}Ge_x/SiWavelength Demultiplexer Based on Multimode Interference

LiBaojun, Li Guozheng, Liu Enke

(Department of Microelectronics Engineering, Xi and Jiaotong University, Xi an 710049)

Received 5 April 1997, revised manuscript received 6 September 1997

Abstract A systematical analysis and design have been made for $1.3\mu m$ and $1.55\mu m$ Si_{0.96} Ge_{0.04}/Siw avelength division multiplexer based on the self-imaging principle of multimode interference U sing the modal propagation analysis, transmission characteristics of the device are investigated. The results show that, at the coupler width of $8\mu m$ and the optimum coupler length of $1150\mu m$, the contrast of this device is as higher as 40 dB, and the insertion loss is less than $4.0 \times 10^{-3} dB$.

EEACC: 6150C, 5230, 1320